

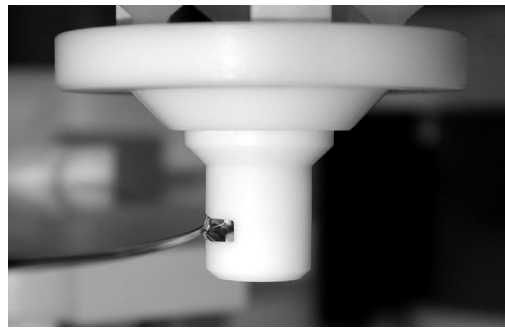
表面張力を利用した水平型回収装置

【応募内容】

シリコンウエハの金属汚染回収（生産歩留まり向上に必要な作業の一環）分野では、近年のウエハサイズ大型化に伴い、従来の表面部汚染回収に加えてベベル部（ウエハ外周の端面）の汚染を回収する需要が急増してきた。

旧来のベベル部汚染回収は、ウエハを垂直に固定する専用の装置が必要であり（表面回収装置はウエハを水平に置く）、また装置の扱いも難しい。そこで、水平に置いたウエハのベベル部汚染回収が可能な回収装置（表面の回収も可能）を開発した。

本装置は、側面に穴をあけた治具に汚染回収用の薬液を注入し、表面張力によってこぼれず治具内に留まっている薬液をウエハの側面に接触させることで、水平に置いたウエハのベベル部汚染回収を可能にしている（写真参照）。また装置はPC制御なので、操作に熟練を要しない。



このベベル部回収技術は国際特許申請済みで、弊社製品以外に同様の回収機能を持つ装置は開発されていない。国内の主要な半導体メーカーの殆どに納入実績があり、今後も関連機器メーカーや分析メーカーに順次納入される予定。

【企業概要】

取締役 役 : 桜井 信夫

本社所在地 : 〒190-1211 東京都西多摩郡瑞穂町大字石畑 192-2

URL : <http://www.geocities.jp/nasgiken/>

業務内容 : シリコンウエハ表面・側面の金属汚染回収装置および関連装置・製品の製造販売

資本金 : 300 万円

沿革 : 創業平成 13 年（業歴創業 4 年）

主な販売・受注先 : 国内の主要半導体メーカー、デバイス（半導体関連機器）メーカー、分析メーカー

従業員数 : 正社員 7 名（パート・アルバイト等 2 名） 平均年齢 45 歳

【連絡先】

担当者 : 桜井 良夫 所属 : 営業部

電話 : 042-557-5207 FAX : 042-557-5368

E - M a i l : Nas_giken@yahoo.co.jp